

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】令和1年8月8日(2019.8.8)

【公開番号】特開2018-156879(P2018-156879A)

【公開日】平成30年10月4日(2018.10.4)

【年通号数】公開・登録公報2018-038

【出願番号】特願2017-53970(P2017-53970)

【国際特許分類】

H 01 J 49/42 (2006.01)

G 01 N 27/62 (2006.01)

【F I】

H 01 J 49/42

G 01 N 27/62

E

【手続補正書】

【提出日】令和1年6月27日(2019.6.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0028】

質量分析装置2は、具体的には、略大気圧であるイオン化室20と高性能の真空ポンプ(図示省略)により真空排気される高真空の分析室23との間に、段階的に真空度が高められた第1中間真空室21および第2中間真空室22を配置した、多段差動排気系の構成を、備える。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0074

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0074】

100 液体クロマトグラフ質量分析装置

1 液体クロマトグラフ部

2 質量分析装置

20 イオン化室

21 第1中間真空室

22 第2中間真空室

23 分析室

231 前段四重極マスフィルタ

2311 メインロッド電極

2312 プリロッド電極

232 コリジョンセル

234 後段四重極マスフィルタ

2341 メインロッド電極

2342 プリロッド電極

235 イオン検出器

3 制御部

301 メソッドファイル設定部

3 0 2 測定制御部
3 0 3 最適値決定部

【手続補正3】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図3】

9

